

LEICA MICROSYSTEMS — МИРОВОЙ ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ МИКРОСКОПИИ, КАМЕР И ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И АНАЛИЗА МАКРО-, МИКРО- И НАНОСТРУКТУР. РАЗЛИЧНЫЕ СЕРИИ ИМЕЮТ РАЗНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, НО ИХ ОБЪЕДИНЯЕТ ОТЛИЧНАЯ ОПТИКА ВЫСОКОГО КЛАССА, УДОБНАЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ВЫСОКОТОЧНАЯ НАДЕЖНАЯ МЕХАНИКА И ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. АССОРТИМЕНТ, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ООО «СИНЕРКОН» ВКЛЮЧАЕТ ВСЮ ЛИНЕЙКУ ПРОДУКЦИИ LEICA: СТЕРЕОМИКРОСКОПЫ, КОНФОКАЛЬНЫЕ, ИНВЕРТИРОВАННЫЕ, ПРЯМЫЕ МИКРОСКОПЫ, МИКРОСКОПНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ И РАЗЛИЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ.

СИНЕРКОН
качество под контролем
SYNERCON

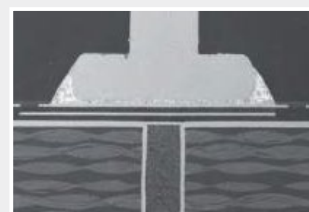
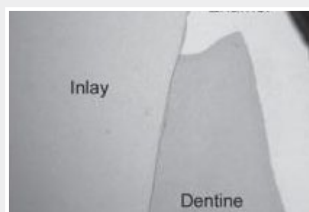
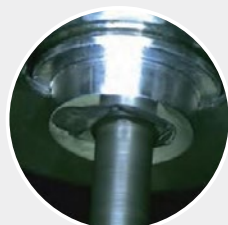
ПРОБОПОДГОТОВКА LEICA ДЛЯ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ



Специализированная система обработки поверхности Leica EM TXP

Leica EM TXP является уникальным прибором для обработки образцов, специально разработанным для получения срезов и полировки образцов перед СЭМ, ПЭМ и ОМ исследованиями. EM TXP является очень эффективным инструментом для предварительной подготовки образца перед ионным травлением и ультрамикротомией.

- **Область применения:** Выявление микроструктуры сталей и сплавов, тонких минеральных включений, получение поперечных срезов объектов микроэлектроники.



117587, МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 118, КОРПУС 1
+7 (495) 741-59-04, 640-91-83, 640-19-71, 640-91-84, 640-19-73
WWW.SYNERCON.RU / INFO@SYNERCON.RU

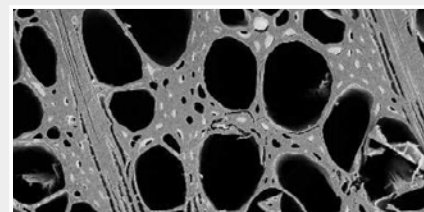
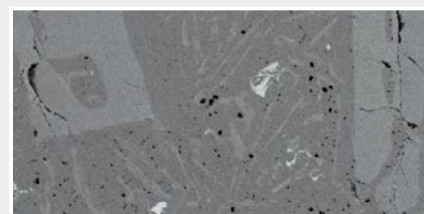
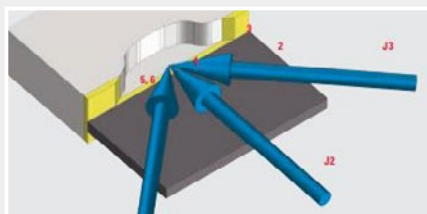
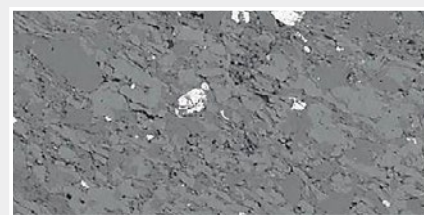
Система трехлучевого ионного травления материалов Leica EM TIC 3X



Система использует принцип одновременного поперечного травления с трех направлений для подготовки поверхности для СЭМ и АСМ исследований, а также проведения ЭДС, ВДС, Оже и ДОРЭ анализа.

К функциональным особенностям прибора можно отнести 3 Ar ионных пушки, столик, перемещающийся в трех направлениях и встроенный стереомикроскоп.

- **Область применения:** Выявление микроструктуры сталей и сплавов, тонких минеральных включений, получение поперечных срезов объектов микроэлектроники.



Система ионно-лучевого травления, очищения и модификации поверхностей образцов Leica EM RES102

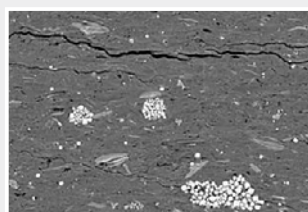
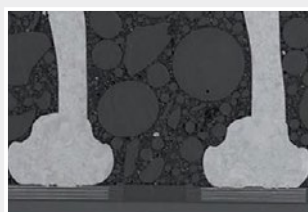
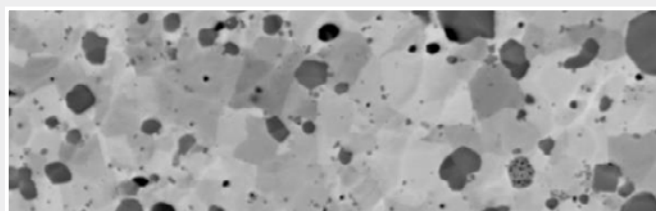
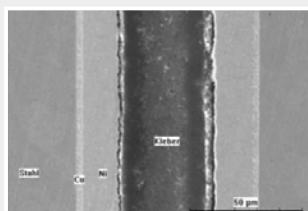
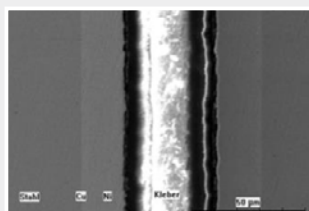


При подготовке образцов к ПЭМ-исследованиям:

- для равномерного ионного утонения;
- для зачистки повреждённых участков поверхности пучками медленных ионов;
- посредством опциональной крио-системы охлаждения осуществлять подготовку образцов без артефактов;

При подготовке к СЭМ- и ОМ-микроскопии:

- полировать шероховатые поверхности;
- очищать образцы после механического шлифования;
- увеличивать контрастность исследуемой поверхности, не прибегая к химическому травлению;
- резать слоистые материалы под углом 35° , а также структурированные полупроводники и оболочки под углом 90° .
- **Область применения:** Выявление микроструктуры сталей и сплавов, тонких минеральных включений, получение сверхтонких срезов.



Система высоковакуумного напыления углеродом и металлами Leica EM ACE 200/600

Системы покрытия EM ACE выпускаются в двух вариантах: установка покрытия EM ACE200 Low Vacuum для общего анализа СЭМ и ПЭМ и установка покрытия EM ACE600 High Vacuum для анализа ПЭМ и FE-СЭМ с наивысшим разрешением. Прибор EM ACE600 легко модернизируется до криоскалывания, включая вакуумный криообмен.

■ **Область применения:** Геология, диэлектрики, полимеры, пластмассы, бумага, стекло и т.д.

EM ACE200/600 можно настроить для следующих методов:

- Испарение углеродной нити (I);
- Распыление (II);
- Испарение углеродных стержней (III);
- Электронно-лучевое испарение (IV);
- Тлеющий разряд.

